(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-142495

(43)公開日 平成5年(1993)6月11日

(51)Int.C1. ⁵ G02B 26/10 B41J 2/44 H04N 1/04	識別記号 103	R号 庁内整理番号 A 7251-5C 7339-2C	FΙ	技術表示箇所			
	104 A		B41J 3/00	00 й			
	•		霍	香請求	未請求	請求項の数2	(全6頁)
(21)出願番号	(71)出願人 000006079						
				ミノル	タカメラ	株式会社	
(22)出願日	平成3年(1991)11月18日		大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル				
			(72)発明者	金井	伸夫		•
	•		,			土町2丁目3番 ルタカメラ株式	
		-	(72)発明者	川口	俊和	•	
						土町2丁目3番	
			(50) 70 75 75			ルタカメラ株式	会社内
			(72)発明者		_		
						土町2丁目3番	
				国際ヒ	ルミノ	ルタカメラ株式	会社内
•							

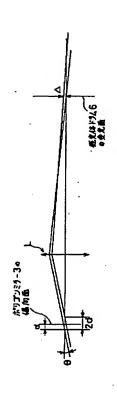
(54)【発明の名称】レーザピーム走査光学系

(57)【要約】

【目的】 ポリゴンミラーの面の出入りによって画像上 に周期的に発生するピッチムラを抑えることを目的とす る。

【構成】 斜め方向からポリゴンミラー3に入射されたレーザピーム20a,20bは、ポリゴンミラー3で偏向された後、結像光学系Lを介して感光体ドラム6上に集光される。ポリゴンミラー3の面の出入りに起因するピッチムラを抑えるために、光軸に対してレーザピーム20a,20bが偏向器に入射する入射角 θ 、結像光学系の副走査方向の倍率 β 、受光面を走査するレーザピームの副走査方向の走査線間隔Piで表わされる条件式を満足させる。

81



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザビーム発生源と、

このレーザビーム発生源から発生されたレーザビームを 走査方向に偏向する偏向器と、

前記走査方向と直交する方向について前記偏向器の偏向 面とレーザビームで走査される受光面とが共役関係とな るように設けられた結像光学系とを備え、

レーザビームが光軸に対して所定の角度で前記偏向器の 偏向面に入射されるレーザビーム走査光学系において、 光軸に対してレーザビームが前記偏向器に入射する入射 10 角をθ、前記結像光学系の前記走査方向と直交する方向 の倍率をβ、受光面を走査するレーザビームの走査方向 と直交する方向の走査線間隔をPiとすると、

 $|\beta*$ tan θ $| \le (5/3)*$ Piの関係を満足するレーザビーム走査光学系。

【請求項2】 前記レーザビーム発生源が第1及び第2のレーザビームを発生し、これら第1及び第2のレーザビームが前記偏向器によって偏向されるとともに、光軸に対して第1及び第2のレーザビームが前記偏向器に入射する入射角をそれぞれ θ a、 θ b、前記偏向器に入射する第1及び第2のレーザビームの走査方向と直交する方向の収束角をそれぞれ ψ a、 ψ bとすると、

 $|\beta*\tan\theta$ a $|\leq$ (5/3)*Pi $|\beta*\tan\theta$ b $|\leq$ (5/3)*Pi $|\theta$ a $|+|\theta$ b $|\geq$ | ψ a $|+|\psi$ b|の関係を満足する請求項1に記載のレーザビーム走査光学系。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザビーム走査光学 30 系、特にレーザビームプリンタやファクシミリ等に用いられるレーザビーム走査光学系に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般的なレーザビーム走査光学系では、 半導体レーザから発生されたレーザビームがコリメータ レンズで平行光にされた後、シリンドリカルレンズを介 してポリゴンミラーの偏向面上に線状に収束される。ポ リゴンミラーで偏向されたレーザビームは、結像光学系 を通過して感光体ドラムに集光される。例えば、特開昭 61-28919は、光軸に対して所定の角度をもって 40 ポリゴンミラーにレーザビームを入射させるレーザビー ム走査光学系を開示している。この公報開示のレーザビー ム走査光学系では、ポリゴンミラーの偏向面と感光体 ドラムの受光面とが共役関係となるように結像光学系が 設けられているため、ポリゴンミラーの面倒れに対する 補正を行える。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記公 リメータレンズ10aにより平行光にされたレーザビー報に開示されたレーザビーム走査光学系では、ポリゴン ム20aをポリゴンミラー3の偏向面近傍で副走査方向ミラーの回転軸から各偏向面までの距離の誤差(面の出 50 について集光する。シリンドリカルレンズ11aを通過

入り)についての対応策が講じられていない。光軸に対して斜めにレーザビームを入射させる場合、ポリゴンミラーに面の出入りがあると、感光体ドラムのレーザビームの照射位置にずれが生じ、画像上に周期的にビッチムラが発生してしまう。

[0004]

【課題を解決しようとする手段】レーザビーム発生源と、このレーザビーム発生源から発生されたレーザビームを走査方向に偏向する偏向器と、前記走査方向と直交する方向について前記偏向器の偏向面とレーザビームで走査される受光面とが共役関係となるように設けられた結像光学系とを備え、レーザビームが光軸に対して所定の角度で前記偏向器の偏向面に入射されるレーザビームを査光学系において、光軸に対してレーザビームが前記偏向器に入射する入射角を θ 、前記結像光学系の前記走査方向と直交する方向の倍率を β 、受光面を走査するレーザビームの走査方向と直交する方向の走査線間隔をPiとすると、

 $|\beta*$ tan θ $| \le (5/3)*$ Piの関係を満足することを特徴とする。

[0005]

【作用】光軸に対してレーザビームが偏向器に入射する 入射角を θ 、結像光学系の走査方向と直交する方向の倍 率を β 、受光面を走査するレーザビームの走査方向と直 交する方向の走査線間隔をPiとすると、

 $|\beta*$ tan θ $| \le (5/3)*$ Pi を満足させることにより、偏向器の面の出入りによって 画像上に周期的に生じるピッチムラを抑える。

[0006]

【実施例】本発明の実施例を図面を用いて説明する。図1は、本実施例におけるレーザピーム走査光学系の斜視図である。図2は、図1のレーザピーム走査光学系における副走査方向からみた構成及び光路を模式的に示す図である。図3は、図1のレーザピーム走査光学系における副走査方向の光路図である。この光学系は、2つの半導体レーザ1a,1bを備えている。これらの半導体レーザ1a,1bから発生されたレーザピーム20a,20bは、感光体ドラム6上の異なる位置に入射される。尚、本実施例において、ポリゴンミラー3の回転によって感光体ドラム6が、走査される方向を主走査方向とし、主走査方向と垂直に交わる方向を副走査方向とする。

【0007】半導体レーザ1 aから発生されたレーザビーム20 aは、コリメータレンズ10 a、第1シリンドリカルレンズ11 aを通過する。コリメータレンズ10 aはレーザビーム20 aを平行光にする。第1シリンドリカルレンズ11 aは、副走査方向にパワーをもち、コリメータレンズ10 aにより平行光にされたレーザビーム20 aをポリゴンミラー3の偏向面近傍で副走査方向について集光する。シリンドリカルレンズ11 aを通過

2

したレーザビーム20aは、ポリゴンミラー3で偏向さ れ、トーリック f θ レンズ 1 2 に向かう。トーリック f**θレンズ12は、主走査方向と副走査方向に異なるパワ** ーをもち、レーザビームによって感光体ドラム6上を一 定速度で走査するように導く。トーリック f θレンズ1 2を通過したレーザビーム20aは、第1折り返しミラ -4a、副走査方向にのみパワーを有する第2シリンド リカルレンズ13a、及び第2折り返しミラー5aを介 して感光体ドラム6に到達する。

ーザピーム20bは、レーザピーム20aと同様に、コ リメータレンズ10bで平行光にされ、第3シリンドリ カルレンズ11bでポリゴンミラー3の偏向面近傍にお いて副走査方向について集光される。第3シリンドリカ ルレンズ11bを通過したレーザビーム20bは、合成 ミラー2で反射されることによりレーザビーム20aと 主走査方向の位置を一致された後、ポリゴンミラー3の 偏向面に向かう。レーザビーム20aが偏向されるポリ ゴンミラー3の偏向面とレーザビーム20bが偏向され ミラー3で偏向されたレーザビーム20bは、トーリッ ク $f\theta$ レンズ12を通過し、第3折り返しミラー4b及 び第4折り返しミラー5 bで反射される。第4折り返し ミラー5 bで反射されたレーザビーム20 bは、副走査 方向にのみパワーを有する第4シリンドリカルレンズ1 3 bを通過して感光体ドラム6に到達する。

【0009】図3に示すように、レーザビーム20a は、第1シリンドリカルレンズ11aを通過する際、光 軸より上方を通過し、光軸に対して上方から所定の角度 向されたレーザピーム20aは、トーリックf θ レンズ 12、第2シリンドリカルレンズ13aにおいて、光軸 より下方を通過する。一方、レーザピーム20bは、第 3シリンドリカルレンズ11bにおいて、光軸よりも下 方を通過し、光軸に対して下方から所定の角度でポリゴ ンミラー3へ入射する。ポリゴンミラー3で偏向された レーザピーム20bは、トーリックf θ レンズ12、第 4シリンドリカルレンズ13bにおいて光軸より上方を 通過する。

【0010】感光体ドラム6上への各レーザビーム20 40 とするためには、

 $|2*0.03*\beta*\tan\theta| \le (1/10)*Pi[mm]$

 $|\beta*\tan\theta| \leq (5/3)*Pi$

を満足させなければならない。

【0014】図1から図3において説明した光学系の場

レーザビーム20bについても同様に、

 $|\beta * \tan \theta b| \leq (5/3) * Pi \cdots 3$

を満足させればよい。但し、 θ a、 θ bはそれぞれ光軸 に対してレーザビーム20a, 20bが偏向器に入射す

a, 20bの到達位置を異ならせるために、レーザビー ム1 bを反射する第3折り返しミラー4 bは、光軸より も上方に設けらる。レーザビーム1aは、光軸よりも下 方を通過するので、第3折り返しミラー4bに反射され ることはなく、第1折り返しミラー4aによって反射さ れる。以上のことから、各レーザピーム20a、20b の感光体ドラム6上への到達位置は異なる。

【0011】また、ポリゴンミラー3の偏向面近傍と感 光体ドラム6上とは、これらの間に設けられた光学系に 【0008】一方、半導体レーザ1 bから発生されたレ 10 関して互いに共役関係にある。これにより、ポリゴンミ ラー3の偏向面の面倒れによる感光体ドラム6上での走 査点のずれを補正できる。

【0012】ポリゴンミラーにレーザビームを斜めから 入射させるレーザビーム走査光学系において、ポリゴン ミラー3の回転軸から各偏向面までの距離に誤差があれ ば(面の出入り)、感光体ドラム6上の走査線の位置が 偏向面毎に異なる。これにより、副走査方向の走査線の 間隔が一定でなくなってしまうため、副走査方向に露光 ムラを生じる。この露光ムラは、画像の濃度ムラの原因 るポリゴンミラー3の偏向面は同一面である。ポリゴン 20 となる。一般に、露光ムラが10%以下であれば、画質 上での問題を生じないとされている。そこで、副走査方 向における走査線の間隔をPi「mm」とすると、副走 査方向の走査間隔に生ずるずれの許容範囲は、(1/1 0) *Pi [mm] 以下である。また、一般のポリゴン ミラーの面の出入りの誤差量は、30 [μm]程度であ

【0013】図4は、ポリゴンミラー3に面の出入りが ある場合の感光体ドラム6上での走査線のずれを説明す るための図である。ポリゴンミラー3の偏向面1面に生 でポリゴンミラー 3へ入射する。ポリゴンミラー 3で偏 30 じた面の出入り量が α [mm] であれば、ポリゴンミラ -3が1回転して生じる面の出入り量は2 α [mm] で ある。また、面の出入り誤差による走査線のずれ量を△ とすると、

 $\Delta = 2a\beta \tan \theta$

で表される。但し、 β は結像光学系L(トーリック $f \theta$ レンズ、シリンドリカルレンズ) の副走査方向の倍率で あり、 θ は光軸に対してレーザビームが偏向器に入射す る入射角である。よって、上記の条件より、

 $|\Delta| \leq (1/10) *Pi$

合、レーザビームが2本であるので、レーザビーム20 aについては、

ラー3に入射するレーザビーム20a, 20bの副走査 方向における収束角を ψ a, ψ bとすると、レーザビー る入射角である。また、図2に示すように、ポリゴンミ 50 ム20a, 20bを良好に合成、分離させるための条件

は、

$(|\theta a| + |\theta b|)/2 > (|\psi a| + |\psi b|)/2$

ゆえに、

 $|\theta a| + |\theta b| > |\psi a| + |\psi b|$

となる。式**②**の条件を満足しない場合、どちらか一方の レーザビームが、もう一方のレーザビームと重なり、ゴ ーストの原因となる。

【0015】尚、本実施例では、2つの半導体レーザを 用いて説明したが、半導体レーザの数はいくつでも良い。

[0016]

【発明の効果】本発明によれば、光軸に対してレーザビームが偏向器に入射する入射角 θ と、結像光学系の走査方向と直交する方向の倍率 β とが、受光面を走査するレーザビームの走査方向と直交する方向における走査線の間隔に対して規定されることで、ポリゴンミラーの面の出入りによって画像上に周期的に発生するビッチムラを抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例におけるレーザビーム走査光学系の斜 20 視図である。

【図2】図1のレーザビーム走査光学系における副走査 方向からみた構成及び光路を模式的に示す図である。

【図3】図1のレーザビーム走査光学系における副走査 方向の光路図である。

【図4】ポリゴンミラー3に面の出入りがある場合の感

光体ドラム6上での走査線のずれを説明する図である。 【符号の説明】

1a, 1b 半導体レーザ

2 合成ミラー

3 ポリゴンミラー

10 4a 第1折り返しミラー

4b 第3折り返しミラー

5a 第2折り返しミラー

5b 第4折り返しミラー

6 感光体ドラム

10a, 10b コリメータレンズ

11a 第1シリンドリカルレンズ

11b 第3シリンドリカルレンズ

12 トーリックf θレンズ

13a 第2シリンドリカルレンズ

13b ~ 第4シリンドリカルレンズ

20a, 20b レーザピーム

 ψa , ψb 収束角

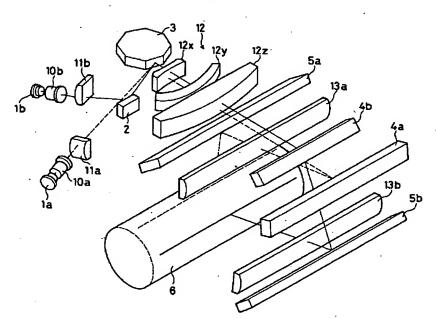
 θ 、 θ a, θ b 入射角

α 面の出入り量

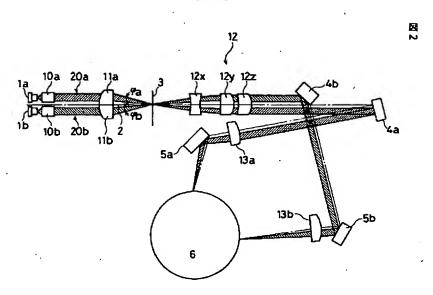
△ 面の出入り誤差による走査線のずれ量

L 結像光学系

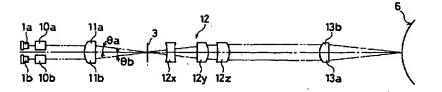
【図1】



[図2]



【図3】



2

[図4]

図 4

